NEAR IR RAY CUT FILTER

Patent number:

JP2003029027

Publication date:

2003-01-29

Inventor:

TAKAGI YUKIHITO

Applicant:

TOKAI KOGAKU KK

Classification:

- international:

G02B5/28; G03B11/00; H01L27/14

- european:

Application number:

JP20010220139 20010719

Priority number(s):

Abstract of JP2003029027

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an interference type near IR cut filter with little variance of fabrication in the manufacturing process in which gradually decreased transmission property in the region from the visible ray region to near IR rays can be stably obtained.

SOLUTION: Two or more kinds of thin films having different refractive indices are alternately deposited to form multilayered films on the surface of a transparent substrate (A). A multilayered film (1) showing high transmission property in the visible ray region and showing gradually decreased transmission property in a long wavelength region of visible rays is formed on the top face of the substrate, while a multilayered film (2) showing high transmission property in the visible ray region and showing low transmission property in the near IR region is formed on the back face of the substrate.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

Best Available Copy

			•
		7	

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-29027 (P2003-29027A)

(43)公開日 平成15年1月29日(2003.1.29)

酸別記号	FI	テーマコード(参考)		
	G 0 2 B 5/28	2H048 2H083		
	G03B 11/00			
	H01L 27/14	D 4M118		
	*	* * *		
	審査請求 未請求 請求項の	数5 OL (全 10 頁)		
特願2001-220139(P2001-220139)	(71)出額人 000219738 東海光学株式会社	-		
平成13年7月19日(2001.7.19)		町字下田5番地26号		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	愛知県岡崎市恵田	町下田5番地26 東海光		
	学、株式会社内	•		
	(74)代理人 100099047			
	弁理士 柴田 淳	<u>·</u>		
	, v	A09 GA14 GA19 GA23		
	GA26 C	A43 GA51 GA61		
•	2H083 AA04 A	A26		
•	4M118 AA10 A	B01 BA10 GC11 GC17		
. *				
		(71)出額人 000219738 東海光学株式会社 平成13年7月19日(2001.7.19) (72)発明者 高木 至人 愛知県岡崎市恵田 学 株式会社内 (74)代理人 100099047 中理士 柴田 淳 下ターム(参考) 214048 GA07 G GA26 G 214083 AA04 A		

(54) 【発明の名称】 近赤外線カットフィルタ

(57)【要約】

【課題】 可視光線領域から近赤外線にかけての領域の なだらかに減衰する透過特性が安定して得られ製造時の 加工ばらつきが少ない干渉タイプの近赤外線カットフィ ルタを提供すること。

【解決手段】 透明な基板A表面に屈折率の異なる2種 以上の薄膜を交互に積層配置してなる多層膜を形成す る。基板の表面側には前記可視光線領域で高透過特性を 示すとともに前記長波長領域でなだらかに減衰する透過 特性を示す多層膜のを形成し、基板の裏面側には前記可 視光線領域で高透過特性を示すとともに前記近赤外線領 域で低透過特性を示す多層膜のを形成するようにする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明な基板表面に屈折率の異なる2種以 上の薄膜を交互に積層配置してなる多層膜を形成し、同 多層膜によって可視光線領域では高透過特性を示すとと もに、近赤外線領域では低透過特性を示し、同可視光線 領域の長波長領域では同近赤外線領域に向かってなだら かに減衰する透過特性を示すように設計した近赤外線カ ットフィルタにおいて、

前記基板の一面には前記可視光線領域で高透過特性を示 すとともに前記長波長領域でなだらかに減衰する透過特 性を示す第1の多層膜を形成し、同基板の他の一面には 前記可視光線領域で高透過特性を示すとともに前記近赤 外線領域で低透過特性を示す第2の多層膜を形成するよ うにしたことを特徴とする近赤外線カットフィルタ。

【請求項2】 前記基板は屈折率の異なる少なくとも1 枚の同基板を含む複数枚が接合された複層構造として構 成されており、前記第1又は第2の多層膜のいずれか一 方を異なる屈折率の同二枚の基板間に形成させ、同いず れか一方の多層膜と少なくとも1枚の同基板を介在させ た状態で他方の多層膜を形成させるようにしたことを特 20 徴とする請求項1に記載の近赤外線カットフィルタ。

【請求項3】 前記基板は同じ屈折率の二枚が同基板と は異なる屈折率の接着剤によって接着された三層構造と して構成されており、前記第1又は第2の多層膜のいず れか一方を同いずれか一方の基板と同接着剤層との間に 形成させ、同いずれか他方の多層膜を同いずれかの基板 の外表面に形成させるようにしたことを特徴とする請求 項1 に記載の近赤外線カットフィルタ。

【請求項4】 前記基板は同じ屈折率の三枚以上が同基 造として構成されており、前記第1又は第2の多層障を 同いずれかの基板と同接着剤層との間に形成するととも に、他方の多層膜を少なくとも両者間に一枚の基板を介 在させた状態でいずれかの基板の表面に形成させ、同第 1又は第2の多層膜を形成させない同いずれかの基板と 同接着剤層との間には反射防止膜を隣接する同反射防止 膜又は同第1又は第2の多層膜との間に少なくとも一枚 の基板を介在させた状態で形成するようにしたことを特 徴とする請求項1に記載の近赤外線カットフィルタ。

【請求項5】 最も外層に配置される前記複数枚の基板 40 の外表面に前記第1の多層膜又は第2の多層膜のいずれ かが形成されていない場合には、同外表面に反射防止膜 を形成するようにしたことを特徴とする請求項2又は3 に記載の近赤外線カットフィルタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明はCCDイメージセ ンサ等の色調補正用の近赤外線カットフィルタに関する ものである。

[0002]

【従来の技術】 ビデオカメラや電子スチルカメラなど では、光学的画像データを電気信号に変換するためにカ ラーCCD素子が使用されているが、CCD素子は人間 の目の感度(一般に人間の可視領域は400nm~70 0 n m である) とは異なり近赤外線領域の1100 n m 付近まで高い感度を有している。従って人間の目で見た 色調バランスを再現するためには不要光としての近赤外 線をカットし、可視光線を取り出すフィルタを用いて光 のトリミングを行う必要がある。とのような目的で用い られる近赤外線カットフィルタには、金属イオン (例え ば2価の銅イオン)を含有したガラスタイプ(またはブ ラスチック) の近赤外線吸収フィルタや、ガラス基板に 無機物を蒸着した干渉フィルタ (コーティング) があ る。ガラス製の吸収タイプの近赤外線カットフィルタは 700nm~1100nm付近まで広い不透過領域を有 し、可視光領域においては人間の目の感度特性に近い綴 やかな透過率特性を有しているため、光電変換後のカラ ーバランス調整が容易でソフトな色調再現が得られる特 徴を持っている。干渉(コーティング)タイプの近赤外 線カットフィルタは、光学薄膜多層膜の干渉効果により 赤外線を反射するフィルタである。とのようなフィルタ は一般に二酸化チタンなどの高屈折率誘電体薄膜と二酸 化珪素などの低屈折率誘電体薄膜を、その光学的膜厚が 1/4波長になるように交互に積層される。一般的な近 赤外カット干渉フィルタは可視域において高い透過率を 示すが、透過帯と反射帯 (不透過帯) の変化が急峻であ ることが特徴である。

【0003】吸収タイプのガラス製近赤外線カットフィ ルタは、透過率特性が人間の視感度特性に近いため広く 板とは異なる屈折率の接着剤によって接着された複数構 30 用いられているが、必要な特性を得るためにはフィルタ 基板に一定の厚さが必要であり、この分の厚みが素子全 体の薄型化の制約となっている。また、透過率特性を変 化させるためには基板の厚みを変化させる必要があり、 光学系の設計にも影響を与えるといった点が課題となっ ている。また、一般に透過帯の透過率が干渉タイプのフ ィルタと比較して低いことも欠点として挙げられる。干 渉タイプの近赤外線カットフィルタは基板の厚さとは無 関係に透過率特性を調整することが可能であるため素子 の薄型化が可能であるが、人間の目の視感度特性のよう になめらかな透過率特性を得ることが困難で、カラーバ ランスの調整が難しい点が課題となっていた。このよう な課題を解決するために本件特許出願以前に特開200 0-314808号に可視光線領域から近赤外線にかけ ての領域の透過特性がなだらかに減衰するようにした技 術が開示されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】 との特開2000-314808号には干渉タイプの近赤外線カットフィル タを設計する際に高屈折材料と低屈折材料からなる薄膜 50 を交互に積層して上記可視光線領域から近赤外線にかけ

ての領域の透過特性をなだらかに減衰させるようにする ことが開示されている。しかし、現実の設計ではなかな か人間の目の視感度特性のようになめらかに可視光線領 域から近赤外線にかけての領域の透過特性を漸減させる ことは困難であった。つまり、可視光線領域から近赤外 線にかけての広い波長帯を理想に近い特性を得るため上 記のような手段に従って各薄膜を設計してもなかなか安 定した製品を得ることは難しく製品のばらつきを生じる **とととなっていた。また干渉タイプの近赤外線カットフ** ィルタは、透明基板上にに数十層におよぶ光学薄膜を積 10 層するため、特に基板の厚みが薄い場合には膜応力によ る基板の反りが発生することがあり、これも製造上の課 題となっていた。本発明は、このような従来の技術に存 在する問題点に着目してなされたものである。その目的 は、可視光線領域から近赤外線にかけての領域のなだら かに減衰する透過特性が安定して得られ製造時の加工は らつきが少ない干渉タイプの近赤外線カットフィルタを 提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】 上記課題を解決するた 20 めに請求項1の発明では、透明な基板表面に屈折率の異 なる2種以上の薄膜を交互に積層配置してなる多層膜を 形成し、同多層膜によって可視光線領域では高透過特性 を示すとともに、近赤外線領域では低透過特性を示し、 同可視光線領域の長波長領域では同近赤外線領域に向か ってなだらかに減衰する透過特性を示すように設計した 近赤外線カットフィルタにおいて、前記基板の一面には 前記可視光線領域で高透過特性を示すとともに前記長波 長領域でなだらかに減衰する透過特性を示す第1の多層 膜を形成し、同基板の他の一面には前記可視光線領域で 高透過特性を示すとともに前記近赤外線領域で低透過特 性を示す第2の多層膜を形成するようにしたことをその 要旨とする。 とのように構成すると、屈折率の異なる2 種以上の薄膜を交互に積層配置してなる多層膜を形成さ せるにあたって、多層膜によって可視光線領域では高透 過特性を示すとともに、近赤外線領域では低透過特性を 示し、同可視光線領域の長波長領域では同近赤外線領域 に向かってなだらかに減衰する透過特性を示すように設 計する際に、可視光線領域〜近赤外線領域にかけての領 域全域の特性をカバーするために1つの多層膜を形成す 40 るのではなく、基板の一面に可視光線領域で高透過特性 を示すとともに前記長波長領域でなだらかに減衰する透 過特性を示す第1の多層膜を形成する。そして、基板の 他の一面に前記可視光線領域で高透過特性を示すととも に前記近赤外線領域で低透過特性を示す第2の多層膜を 形成する。そして、第1の多層膜と第2の多層膜のそれ ぞれの特性を総合した特性によって可視光線領域〜近赤 外線領域にかけての領域全域の特性をカバーするように する。ととに、高透過特性とは必ずしも100%の透過 率を要求するのものではないが90%より大きな透過率

であることが好ましい。低透過特性とは0%の透過率を 要求するのものではないが5%より小さな透過率である ことが好ましい。また、可視光線領域とは一般に400 nm付近から700nm付近の範囲をいうが、厳密に規 定されるものではない。若干シフトしたり、350nm 付近から750nm付近をいう場合もある。近赤外線領 域とは可視光線領域に隣接した可視光線領域よりも波長 の長い領域であって、一般に700ヵm付近から110 0 n m付近の範囲をいうが、厳密に規定されるものでは ない。若干シフトしたり、750nm付近から1200 nm付近をいう場合もある。可視光線領域の一部をなす 長波長領域は一般に500nm付近から700nm付近 の範囲をいうが、厳密に規定されるものではない。若干 シフトしたり、500nm付近から750nm付近をい う場合もある。長波長領域でなだらかに減衰する透過特 性を示すとは長波長領域において極端な変曲点を示さず に略直線状に高透過領域から低透過領域へと下がるよう な傾きである。

【0006】また請求項2の発明では請求項1の発明の 構成に加え、前記基板は屈折率の異なる少なくとも1枚 の同基板を含む複数枚が接合された複層構造として構成 されており、前記第1又は第2の多層膜のいずれか一方 を異なる屈折率の同両基板間に形成させ、同いずれか一 方の多層膜と少なくとも1枚の同基板を介在させた状態 で他方の多層膜を形成させるようにしたことをその要旨 とする。 請求項2の発明ではこのように構成したことで、 請求項1の発明の作用に加え次のような作用が奏され る。すなわち、複数枚の基板を接合しそのうちの少なく とも1枚が屈折率の異なる場合がある。この場合には屈 折率の違いから反射の問題が生ずる。複数枚の基板を接 合した場合にはそのうちの少なくとも1枚が屈折率の異 なる場合において屈折率の異なる基板の間に第1又は第 2の多層膜を形成させる。 この位置に配置された多層膜 は可視光線領域における屈折率の異なる基板同士の反射 防止機能を併せ持つこととなる。尚、接合方法において 両基板が接着剤にて接着されている場合にはこの多層膜 はいずれかの基板と接着剤層との間に形成されることと なる。一方、他方の多層膜は少なくとも1枚の同基板を 介在させた状態で形成される。 すなわち第1の多層膜と 第2の多層膜間には常に基板が配置されている。また請 求項3の発明では請求項1の発明の構成に加え、前記基 板は同じ屈折率の二枚が同基板とは異なる屈折率の接着 剤によって接着された三層構造として構成されており、 前記第1又は第2の多層膜のいずれか一方を同いずれか 一方の基板と同接着剤層との間に形成させ、同いずれか 他方の多層膜を同いずれかの基板の外表面に形成させる ようにしたことをその要旨とする。請求項3の発明では このように構成したことで請求項1の発明の作用に加え 次のような作用が奏される。すなわち、同じ屈折率の基 板であっても接合を屈折率の異なる接着剤で行った場合

にはこの接着剤と基板との間の屈折率の違いから反射の 問題が生ずる。この場合にはいずれかの基板と接着剤層 の間に第1又は第2の多層膜を形成させる。 との位置に 配置された多層膜は可視光線領域における屈折率の異な る基板同士の反射防止機能を併せ持つとととなる。一 方、他方の多層膜はいずれかの基板の外表面に形成され る。また請求項4の発明では請求項1の発明の構成に加 え、前記基板は同じ屈折率の三枚以上が同基板とは異な る屈折率の接着剤によって接着された複数構造として構 成されており、前記第1又は第2の多層膜を同いずれか の基板と同接着剤層との間に形成するとともに、他方の 多層膜を少なくとも両者間に一枚の基板を介在させた状 態でいずれかの基板の表面に形成させ、同第1又は第2 の多層膜を形成させない同いずれかの基板と同接着剤層 との間には反射防止膜を隣接する同反射防止膜又は同第 1又は第2の多層膜との間に少なくとも一枚の基板を介 在させた状態で形成するようにしたことをその要旨とす る。請求項4の発明ではこのように構成したことで請求 項1の発明の作用に加え次のような作用が奏される。す なわち、同じ屈折率の基板であっても接合を屈折率の異 なる接着剤で行った場合にはこの接着剤と基板との間の 屈折率の違いから反射の問題が生ずる。この場合には反 射防止膜をいずれかの基板と接着剤層の間に形成させる が、そのうちの二枚の反射防止膜を第1又は第2の多層 膜によって代替させる。また請求項5の発明では請求項 2又は3の発明の構成に加え、最も外層に配置される前 記複数枚の基板の外表面に前記第1の多層膜又は第2の 多層膜のいずれかが形成されていない場合には、同外表 面に反射防止膜を形成するようにしたことをその要旨と する。このように構成すると請求項5の発明では請求項 2又は3の発明の作用に加え、第1の多層膜又は第2の 多層膜が最外層の基板の外表面に形成されていないとそ の最外層の基板自体の反射の防止効果が期待できない。 そのため反射防止膜を最外層の基板の外表面に形成す

[0007]

【発明の効果】請求項1~4の発明では、基板の一面に可視光線領域で高透過特性を示すとともに前記長波長領域でなだらかに減衰する透過特性を示す第1の多層膜を形成し、基板の他の一面に前記可視光線領域で高透過特性を示すとともに前記近赤外線領域で低透過特性を示す第2の多層膜を形成するようにし、第1の多層膜と第2の多層膜のそれぞれの特性を総合した特性によって可視光線領域へ近赤外線領域にかけての領域全域の特性をカバーするようにした。そのため、薄膜の設計に無理がなく、安定して可視光線領域から近赤外線にかけての領域のなだらかに減衰する透過特性が得られることとなり、製造時の加工ばらつきが少なくなる。また、請求項2の発明では上記効果に加え、屈折率の異なる少なくとも1枚の基板を含む複数の基板を接合した近赤外線カットフ

6 . 用 4、2 甘 4 5 同 4、0 明 25 体 1、2

ィルタにおいて屈折率の異なる基板同士の間に第1又は 第2のいずれか一方の多層膜を形成させる。少なくとも 1枚の基板を挟んでいずれか他方の多層膜を形成させる ようにした。そのため、第1の多層膜及び第2の多層膜 は屈折率の異なる基板間の反射防止機能も併せ持つとと となり、屈折率の異なる基板同士の間に別個の反射防止 層をわざわざ形成させる必要がなくなる。また、請求項 3の発明では上記効果に加え、同じ屈折率の二枚の基板 を同基板とは異なる屈折率の接着剤によって接着した三 層構造の近赤外線カットフィルタにおいて基板と接着剤 層の間に第1又は第2のいずれか一方の多層膜を形成さ せようにし、いずれか基板の外表面に第1又は第2のい ずれか他方の多層膜を形成させようにした。そのため、 第1の多層膜及び第2の多層膜は屈折率の異なる基板間 の反射防止機能も併せ持つこととなり、屈折率の異なる 基板同士の間に別個の反射防止層をわざわざ形成させる 必要がなくなる。また、請求項4の発明では上記効果に 加え、同じ屈折率の複数の基板を同基板とは異なる屈折 率の接着剤によって接着した複数構造の近赤外線カット 20 フィルタにおいて基板と接着剤層の間に第1又は第2の いずれか一方の多層膜を形成させ、いずれか他方の多層 膜を少なくとも一枚の基板を介在させて形成するように した。そしてその他の反射防止が必要な箇所には反射防 止層を形成した。そのため、第1の多層膜及び第2の多 層膜が反射防止層を兼ねるため反射防止層の形成工程を 省略するととができる。また、請求項5の発明では上記 請求項2又は3の発明の効果に加え、第1の多層膜又は 第2の多層膜が最外層の基板の外表面に形成されていな いとその最外層の基板自体の反射の防止効果が期待でき ない。そのため反射防止膜を最外層の基板の外表面に形 成することによって基板自体の反射を防止することがで きる。

[0008]

【発明の実施の形態】 以下、本発明の具体的な実施の 形態を図面に基づいて説明する。

(実施の形態1)図1に示すように、本実施の形態1の近赤外線カットフィルタは基板Aの表裏にそれぞれ第1の多層膜としての多層膜Φ及び第2の多層膜としての多層膜Φが形成されて構成されている。多層膜Φは酸化アルミニウム膜(これは中間屈折材料とされる)及び二酸化珪素膜(これは低屈折材料とされる)及び二酸化珪素膜(これは低屈折材料とされる)の透明誘電体薄膜から構成されている。酸化アルミニウム膜を第1層とし、その後二酸化チタン膜と二酸化珪素膜を交互に積層した11層膜構造とされている。多層膜Φも同様に酸化アルミニウム膜、二酸化チタン膜及び二酸化珪素膜の透明誘電体薄膜から構成され、酸化アルミニウム膜を第1層とし、その後二酸化チタン膜と二酸化珪素膜を交互に積層した41層膜構造とされている。多層膜Φ及び多層膜Φを構成する各層の膜厚は設計波長をλとした場合に0.

8

1×1/4 λ~3. 0×1/4 λの範囲で希望の特性を 満足するように最適化される。また、各層は真空蒸着法 により定石に従って1層から順に蒸着形成される。との ように構成される多層膜の及び多層膜のの近赤外線カッ トフィルタの透過率特性曲線を図2のグラフに示す。多 層膜のは可視光線領域に重点をおいた設計とされ、40 0 n m付近から550 n m付近にかけては95%以上の 透過率に設計され550nm付近から750nm付近に かけての長波長領域においてなだらかに減衰する透過特 性を示すように設計されている。多層膜②は近赤外線領 10 域に重点をおいた設計とされ、450nm付近から65 0 n m付近にかけては95%以上の透過率に設計され6 50 nm付近から720 nm付近にかけて一気に透過率 を落とし720nm付近から1050nm付近にかけて は0%に近い透過率に設計されている。このような2つ の総合特性を示す透過率特性曲線(縦軸を透過率と、横 軸を波長としている。以下のグラフも同様)のグラフを 図3に示す。との特性曲線は多層膜の及び多層膜のの特 性の積によって表される。 図3の透過率特性曲線につい て製造上発生する各層の膜厚誤差を2%と仮定した場合 20 の誤差シミュレーション結果を図4のグラフに示す。と のようにランダムな膜厚変動に対しても高透過帯から阻 止帯 (不透過帯) へ遷移する領域において滑らかに変化 する透過率特性を維持しており、生産ばらつきを考慮し た場合にも安定した特性が得られることがわかった。

【0009】(実施の形態2)実施の形態2の近赤外線 カットフィルタは実施の形態1の近赤外線カットフィル タの多層膜Φを多層膜Φとし、多層膜Φを多層膜Φと置 き換えたものである。多層膜団は多層膜団同様酸化アル ミニウム、二酸化チタン、二酸化珪素の透明誘電体薄膜 30 で、その層構造も同じであるが多層膜**Φ**が11層膜構造 であるところ25層膜構造とされている。多層膜のは多 層膜②同様酸化アルミニウム、二酸化チタン、二酸化珪 素の透明誘電体薄膜で、その層構造も同じであるが多層 膜②が41層膜構造であるところ27層膜構造とされて いる。とのように構成される多層膜の及び多層膜のの近 赤外線カットフィルタの透過率特性曲線を図5のグラフ に示す。多層膜③は可視光線領域及び近赤外線領域の前 半(700nm付近から850nm付近)に重点をおい た設計とされ、450 n m 付近から550 n m 付近にか 40 けては95%以上の透過率に設計され550nm付近か 5720nm付近にかけての長波長領域においてなだら かに減衰する透過特性を示すように設計され、更に72 0nm付近から850nm付近にかけては0%に近い透 過率に設計されている。多層膜のは近赤外線領域の後半 (850nm付近から1100nm付近) に重点をおい た設計とされ、この領域で0%に近い透過率に設計され ている。このような2つの総合特性を示す透過率特性曲 線のグラフを図6に示す。との特性曲線は多層膜3及び 多層膜のの特性の積によって表される。 実施の形態2で

も実施の形態1より若干劣るものの実施の形態1と同様に安定した特性が得られる。更に表裏の層数がほぼ拮抗しているため厚みの薄い基板に対して有効である。このように基板表裏に積層する多層膜の膜数(膜厚)を近づけることによって膜応力を相殺し、基板変形を緩和することが可能である。

【0010】(実施の形態3)図7に示すように、本実 施の形態3の近赤外線カットフィルタは屈折率の異なる 2つの基板A、Bが接着材にて接合され、基板Aの表面 (図上左方) に多層膜 5が形成され、基板 Bの裏面(図 上右方) に第2の多層膜としての多層膜のが形成され、 接着材層と基板B(の表面)との間に第1の多層膜とし ての多層膜のが形成されて構成されている。基板Aは水 晶から構成された透明基板とされ、基板Bは基板Aに対 して1.5倍程度の屈折率を有する高屈折率透明基板と される。基板Aの裏面側と多層膜のの最外層は基板Aと 同等の屈折率を有する接着剤(層)で接着されている。 実施の形態3における多層膜のは酸化アルミニウム、フ ッ化マグネシウム、酸化ジルコニウムの透明誘電体薄膜 で構成されている。酸化アルミニウム膜を第1層とし、 その後酸化ジルコニウムとフッ化マグネシウムを交互に 積層した5層膜構造とされている。多層膜のは多層膜の 同様酸化アルミニウム、二酸化チタン、二酸化珪素の透 明誘電体薄膜で、その層構造も同じであるが多層膜Φが 11層膜構造であるところ13層膜構造とされている。 多層膜のは多層膜の同様酸化アルミニウム、二酸化チタ ン、二酸化珪素の透明誘電体薄膜で、その層構造も同じ であるが多層膜②が41層膜構造であるところ43層膜 構造とされている。多層膜5、6及び0を構成する各層 の膜厚は設計波長を λ とした場合に $0.1 \times 1/4\lambda$ ~ 3. 0×1/4 λの範囲で希望の特性を満足するように 最適化される。また、各層は真空蒸着法により定石に従 って1層から順に蒸着形成される。とのように構成され る多層膜5、6及び0の近赤外線カットフィルタの透過 率特性曲線を図8のグラフに示す。多層膜のは可視光線 領域に重点をおいた設計とされ、400nm付近から5 50 nm付近にかけては95%以上の透過率に設計され 550nm付近から750nm付近にかけての長波長領 域においてなだらかに減衰する透過特性を示すように設 計されている。多層膜のは近赤外線領域に重点をおいた 設計とされ、450nm付近から650nm付近にかけ ては95%以上の透過率に設計され650nm付近から 720nm付近にかけて一気に透過率を落とし720n m付近から1050nm付近にかけては0%に近い透過 率に設計されている。多層膜のは可視光線領域から近赤 外線領域のほぼ全域 (350nmから1200nm) に 渡ってほぼ90%以上の透過率特性を示し、特に必要な 反射防止領域である可視光線領域(400 n mから70 0nm)ではほぼ100%の透過率特性を示す。多層膜 ⑤は基板Aの反射防止機能を担保する層である。 このよ

9

うな多層膜の及びのの2つの総合特性を示す透過率特性 曲線のグラフを図9に示す。この特性曲線は多層膜の及び多層膜の特性の積によって表される。

【0011】 ここに、このように2種の異なる屈折率を 有する基板を使用するのは次のような理由による。近赤 外線カットフィルタにローバス機能を持たせたいわゆる 複合フィルタが開発されている。ローパス機能はモアレ 縞の発生の抑制を目的としたもので、具体的にはローバ スフィルタとして復屈折を有する水晶基板が使用されて きた。この場合には近赤外線カットフィルタの基板とロ ーパスフィルタとして水晶基板との材質が同じであるた め特に問題はない (但し、接着剤層の屈折率も水晶基板 と同等であること)。ところが、このような構成では全 体の厚さが増し、近年の撮像機器の小型化の要請に応え ることが困難になってきた。そのため、水晶と同等のロ ーパス機能を有し、より薄い材質のローパスフィルタが 使用されるようになってきた。しかし、これら新たなロ ーバスフィルタ材料は水晶とは異なる屈折率であるため 新たに基板間の反射の問題が生じることとなっていた。 そのために本実施の形態3ではこの異なる屈折率を原因 とする反射を防止するための反射防止膜として多層膜の を使用する。多層膜のは上記のように可視光線領域で高 透過特性を示すとともに前記長波長領域でなだらかに減 衰する透過特性を示すような設計をした層であるが可視 光線領域で高透過特性を示しているため、そのまま反射 防止膜として機能させることが可能である。そのため異 なる屈折率の基板A、B同士を接着する場合に、接着剤 と基板の屈折率差の大きな面に多層膜6を適用すること により反射防止効果を併せて持たせることが可能とな る。また、実施の形態3でも実施の形態1と同様安定し 30 た特性が得られる。

【0012】なお、との発明は、次のように変更して具体化することも可能である。

- ・上記各実施の形態では接着剤との境界面側に視感度・ 色調調整機能を有する多層膜を適用したが、適用面を逆 にし、接着面側に近赤外線カット機能を有する多層膜を 適用することも可能である。
- ・上記各実施の形態では膜材料として酸化アルミニウム、二酸化チタン、二酸化珪素、フッ化マグネシウム、酸化ジルコニウムを用いているが、これらの材料に限定 40 されることはなく、光学特性の最適化や膜応力調整の目的で他の膜材料を用いることも可能である。
- ・透過率特性に関しても上記各実施の形態の図の例に限定されるものではなく、例えば図10のように可視域での透過率特性を変化させたい場合には、第1の実施の形態において多層膜のの特性のみを変化させることで対応することが可能である。
- ・上記各実施の形態に使用した接着剤は基板Aと同等の の総合特性を元屈折率を有するものを使用した。しかし、異なる屈折率 【図7】 本多の接着剤を使用した近赤外線カットフィルタに応用する 50 ルタの概念図。

ととも可能である。

- ·図11のように同じ屈折率の二枚の基板Bをこれらと は異なる屈折率の接着剤によって接着された三層構造の 近赤外線カットフィルタにおいて、図上右方の基板Bと 接着剤の間に第1の多層膜としての多層膜のが形成され ている。そして図上右方の基板Bの外表面に第2の多層 膜としての多層膜のを、図上左方の基板Bの外表面に各 多層膜のが形成されている。この実施の形態は実施の形 態3における基板Aを基板Bに変更したものである。と の場合には多層膜のは基板Bと接着剤層との間で生じる 反射を防止する反射防止膜となる。このように構成して も上記各実施の形態と同様に安定した特性が得られる。 ・図12のように同じ屈折率の複数の(ことでは四枚) の基板Bをこれらとは異なる屈折率の接着剤によって接 着された複層構造の近赤外線カットフィルタにおいて、 図上左から二番目の基板Bの左右にそれぞれ接着剤層に 挟まれるように第1の多層膜としての多層膜のと第2の 多層膜としての多層膜のが形成されている。そして反射 防止が必要な箇所に反射防止膜としての多層膜の及び多 層膜®が形成されている。多層膜®及び多層膜®は同様
- ・上記実施の形態3 においてさらに複数の基板を接合することも可能である。

の機能を有するが多層膜のは基板Bと接着剤層の間に形

成されているため多層膜のとは若干特性が異なる。この

ように構成しても上記各実施の形態と同様に安定した特

性が得られる。ととで、各多層膜の、⑥、⑦及び⑧の配

置位置を相互に入れ替えることも可能である。

- ・上記実施の形態3において各多層膜5、6及びCの配置位置を相互に入れ替えることも可能である。
- ・図12に示す実施の形態において基板Bの枚数は適宜 変更可能である。

その他本発明の趣旨を逸脱しない態様で実施するととは自由である。

[0013]

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施の形態1の近赤外線カットフィルタの概念図。

【図2】 同実施の形態1における多層膜Φと多層膜Φ の透過率特性曲線グラフ。

【図3】 同実施の形態1における多層膜のと多層膜の の総合特性を示す透過率特性曲線グラフ。

【図4】 図3において膜厚誤差を2%と仮定した場合の誤差シミュレーション結果としての透過率特性曲線グラフ。

【図5】 本発明の実施の形態2における多層膜のと多層膜のの透過率特性曲線グラフ。

【図6】 同実施の形態2における多層膜②と多層膜② の総合特性を示す透過率特性曲線グラフ。

【図7】 本発明の実施の形態3の近赤外線カットフィルタの概念図。

12

【図8】 同実施の形態3における多層膜のと多層膜の の透過率特性曲線グラフ。

11

【図9】 同実施の形態3における多層膜®と多層膜® の総合特性を示す透過率特性曲線グラフ。

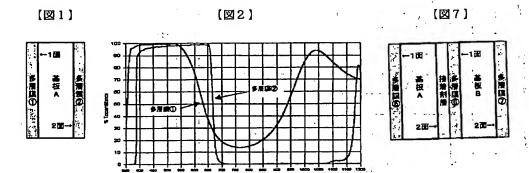
【図10】 他の実施の形態におけ総合特性を示す透過 率特性曲線グラフ。

*【図11】 本発明の他の実施の形態の近赤外線カットフィルタの概念図。

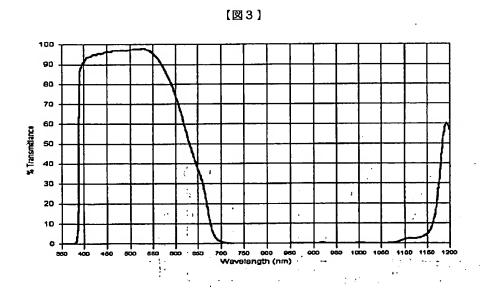
【図12】 本発明の他の実施の形態の近赤外線カットフィルタの概念図。

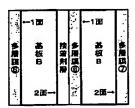
【符号の説明】

①~8…多層膜。

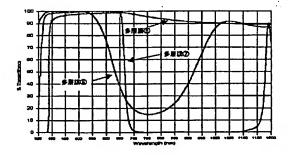


【図11】





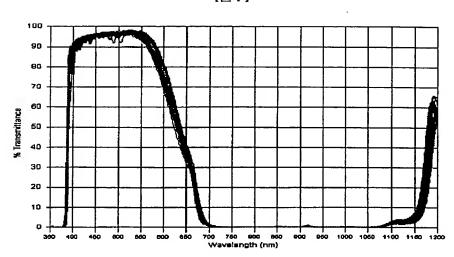
【図8】



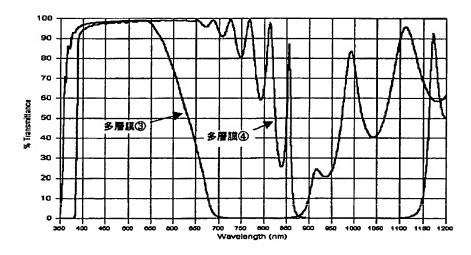
【図12】

	←1 図		14.	⊷1亩			←1 률 '		. '	1四	
· 的斯斯特	基 板 B	接着剪用	电型的	極8	多層膜の	按着剂质	基框日	技術利用	外尺四份	福田	(B)新疆(4)
	2∰→		la der ist	2箇→			2面→		;. · . ·	2面→	9.55

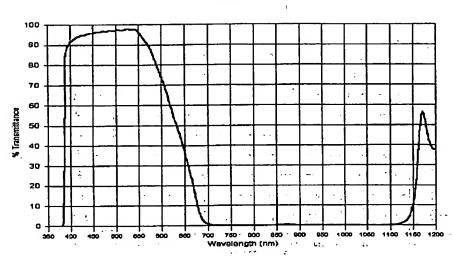
【図4】



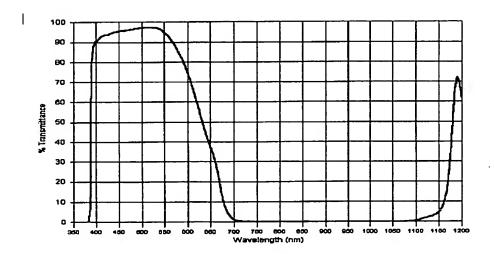
【図5】







【図9】



【図10】

